

ナノ材料評価・解析装置(S-4800 タイプ II)

高精度な試料作製装置と組み合わせることにより、様々な材料の表面を数十万倍の超高倍率、超高分解能で観察できる装置です。電界放出形電子銃による電子線を観察プローブとして用いることにより、1nm の分解能にて材料の表面を観察できます。超高分解能のため、観察試料の作製に細心の注意が必要となりますが、付属のイオンミリング装置により、比較的容易な試料作製が可能となっています。



主な仕様

項 目		内 容
分解能		1nm(加速電圧 15kV) 1.5nm(加速電圧 1kV)
加速電圧		0.1～30kV
倍率		20～800,000 倍
信号検出	二次電子検出器	上下 2 器装備 上検出器は電子線エネルギーのフィルタリングにより反射電子情報も取得可能
	透過電子検出器	STEM 像取得可能
	エネルギー分散型 X 線分析装置	分解能 136eV 以下にて Be～U までの元素分析が可能
試料ステージ	X 軸	0～110mm
	Y 軸	0～110mm
	Z 軸	1.5～40mm
	ローテーション	360°
	チルト	-5～70°